

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第 6 部門第 1 区分  
 【発行日】平成 27 年 10 月 29 日 (2015.10.29)

【公開番号】特開 2014-52222 (P2014-52222A)  
 【公開日】平成 26 年 3 月 20 日 (2014.3.20)  
 【年通号数】公開・登録公報 2014-015  
 【出願番号】特願 2012-195457 (P2012-195457)  
 【国際特許分類】

G 0 1 B 5/20 (2006.01)

G 0 2 C 13/00 (2006.01)

【 F I 】

G 0 1 B 5/20 D

G 0 2 C 13/00

【手続補正書】  
 【提出日】平成 27 年 9 月 3 日 (2015.9.3)  
 【手続補正 1】  
 【補正対象書類名】特許請求の範囲  
 【補正対象項目名】全文  
 【補正方法】変更  
 【補正の内容】  
 【特許請求の範囲】  
 【請求項 1】

眼鏡フレームのリムの前側及び後側を所定位置で保持するフレーム保持手段と、リムのヤゲン溝に挿入される測定子と、測定子をリムのヤゲン溝に沿わせて移動するための移動手段と、ヤゲン溝に沿って移動される前記測定子の位置を検知する検知手段と、前記移動手段を制御し、前記検知手段の検知結果に基づいてリムの形状の測定データを得る制御手段と、を備える眼鏡枠形状測定装置において、  
前記制御手段は、リムの測定開始点から前記測定子を移動させることによって得られた測定データの変化に基づき、測定開始点で前記測定子が前記ヤゲン溝に挿入された第 1 状態と、測定開始点で前記測定子が前記ヤゲン溝に挿入されていない第 2 状態と、の何れの状態で測定が開始されたかを判定し、前記第 2 状態で測定が開始されたときとは再測定に移行し、再測定では、前記第 1 状態で測定が開始されたときに行う前記移動手段の制御に対して少なくとも一部の動作を変更することを特徴とする眼鏡枠形状測定装置。

【請求項 2】

請求項 1 の眼鏡枠形状測定装置において、  
前記制御手段は、再測定では、再測定で得られた測定データの変化に基づき、前記測定子の移動途中で前記測定子が前記ヤゲン溝に挿入されたか否かを判定し、該判定によって前記測定子が前記ヤゲン溝に挿入されたときと判定された地点から前記測定子を前記ヤゲン溝に沿って移動させ、リムの全周形状の測定データを得るように前記移動手段を制御することを特徴とする眼鏡枠形状測定装置。

【請求項 3】

請求項 1 又は 2 の眼鏡枠形状測定装置において、  
前記制御手段は、再測定では、前記測定子をリムから離脱させた後、リムの前後幅のほぼ中央位置に前記測定子を接触させるように前記移動手段を制御し、そして、(a) リムの前後幅方向における前記測定子の接触位置を維持した状態で、リムの耳側方向に測定子を移動させるように前記移動手段を制御するか、又は (b) 測定子をリムの前側方向に向かわせつつ、リムの耳側方向に測定子を移動させるように前記移動手段を制御するか、の何れかを行うことを特徴とする眼鏡枠形状測定装置。

## 【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0006

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0006】

上記課題を解決するために、本発明は以下のような構成を備えることを特徴とする。

(1) 眼鏡フレームのリムの前側及び後側を所定位置で保持するフレーム保持手段と、リムのヤゲン溝に挿入される測定子と、測定子をリムのヤゲン溝に沿わせて移動するための移動手段と、ヤゲン溝に沿って移動される前記測定子の位置を検知する検知手段と、前記移動手段を制御し、前記検知手段の検知結果に基づいてリムの形状の測定データを得る制御手段と、を備える眼鏡枠形状測定装置において、前記制御手段は、リムの測定開始点から前記測定子を移動させることによって得られた測定データの変化に基づき、測定開始点で前記測定子が前記ヤゲン溝に挿入された第1状態と、測定開始点で前記測定子が前記ヤゲン溝に挿入されていない第2状態と、の何れの状態で測定が開始されたかを判定し、前記第2状態で測定が開始されたと判定したときには再測定に移行し、再測定では、前記第1状態で測定が開始されたとときに行う前記移動手段の制御に対して少なくとも一部の動作を変更することを特徴とする。

(2) (1)の眼鏡枠形状測定装置において、前記制御手段は、再測定では、再測定で得られた測定データの変化に基づき、前記測定子の移動途中で前記測定子が前記ヤゲン溝に挿入されたか否かを判定し、該判定によって前記測定子が前記ヤゲン溝に挿入されたと判定された地点から前記測定子を前記ヤゲン溝に沿って移動させ、リムの全周形状の測定データを得るように前記移動手段を制御することを特徴とする。

(3) (1)又は(2)の眼鏡枠形状測定装置において、前記制御手段は、再測定では、前記測定子をリムから離脱させた後、リムの前後幅のほぼ中央位置に前記測定子を接触させるように前記移動手段を制御し、そして、(a)リムの前後幅方向における前記測定子の接触位置を維持した状態で、リムの耳側方向に測定子を移動させるように前記移動手段を制御するか、又は(b)測定子をリムの前側方向に向かわせつつ、リムの耳側方向に測定子を移動させるように前記移動手段を制御するか、の何れかを行うことを特徴とする。

。